

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายณัฐที ถึงสุข
วัน เดือน ปีเกิด	24 พฤศจิกายน 2518
ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2542
ระดับปริญญาโท	ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550
ระดับปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2557
ประวัติการทำงาน	2543 – 2547 อาจารย์แผนกไฟฟ้า โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 2547– 2547 วิศวกร บริษัทบางกอก ชันโย สปริง จำกัด 2547 – 2548 อาจารย์แผนกไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 2548 – 2551 หัวหน้าแผนกไฟฟ้า โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 2551 – 2552 อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 2552–ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

Thungsuk, N., Yuji, T., Kasayapanand, N., Mungkung, N., Nuachauy, P., Arunrungrusmi, S., Nakabayashi, K., Okamura, Y., Kinoshita, H., Kataoka, H., Suzaki, Y., and Hirata, T, “Low-Temperature Naturatron Sputtering System for Deposition of Indium Tin Oxide Film”, **IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE**, VOL. 42, NO. 10, OCTOBER 2014, pp. 3391-3396.

Thungsuk, N., Yuji, T., Mungkung, N., Okamura, Y., Fujimaru, A., Kinoshita, H., Hirotani, D., Kawano, M., and Kasayapanand, N, “The Development of Polyethylene Naphthalate Films by Low-pressure High-frequency Plasma Chemical Vapor Deposition System with Advance Oxidations Process”, **Journal of Advance oxidation technologies**, Vol. 18, No. 1, January 2015, pp. 123-128.

Thungsuk, N., Nuchauy, P., Hirotani, D., Okamura, Y., Nakabayashi, K., Kinoshita, H., Yuji, T., Mungkung, N., and Kasayapanand, N, “Development of low-pressure high-frequency plasma chemical vapor deposition method on surface modification of silicon wafer”, **Vacuum**, Vol. 109, July 2014, pp. 166-169.

การประชุมวิชาการนานาชาติ

Thungsuk, N., Yuji, T., Kasayapanand, N., Mahawan, C., Arunrungrusmi, S., and Mungkung, N, “An Analysis of Low-Pressure High-Frequency Plasma Chemical Vapor Deposition System for Flexible Solar Cell Characteristics”, **2015 International Conference on Intelligent Materials and Manufacturing Engineering (IMME2015)**, 16-17 January 2015, Phuket Island, Thailand.

การประชุมวิชาการนานาชาติ

Thungsuk, N., Yuji, T., Tanarum, T., Kinoshita, H., Okamura Y., Kasayapanand, N., and Mungkung, N, “The investigation of silicon wafer for flexible solar cell by development low-pressure high-frequency plasma chemical vapor deposition method”, **International Conference on Science, Technology, Engineering and Management(ICSTEM)**, 15 November 2014, Macau, China.

Thungsuk, N., Yuji, T., Tanarum, T., Kinoshita, H., Okamura, Y., Kasayapanand, N., and Mungkung, N, “The improvement adhesive characteristic for flexible solar cell by low-pressure high-frequency plasma chemical vapor deposition system”, **International Conference on Science, Technology, Engineering and Management (ICSTEM)**, 15 November 2014, Macau, China.

Thungsuk, N., Yuji, T., Mungkung, N., Okamura, Y., Kinoshita, H., Suzaki, Y., and Kasayapanand, N, “Investigation of PEN film for Flexible Dye Sensitized Solar Cell Electrode by Development Low-Pressure High-Frequency Plasma Chemical Vapor Deposition System”, **3rd Japan-Thailand Friendship International Workshop on Science, Technology & Education (3rd JTSTE 2014) [Technology, Hand-making, Engineering, Energy & Environmental]**, 28-29 August 2014, Chiang mai, Thailand